

Ф – Аннотация рабочей программы дисциплины

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Профессиональный электив «Материаловедение в микроэлектронике»

по направлению 28.03.02 «Наноинженерия»

(бакалавриат)

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели освоения дисциплины:

- формирование у студентов систематизированных знаний и практических навыков в области физических и физико-химических процессов, лежащих в основе современных технологий, применяемых в тонкопленочном и оптоэлектронном производстве, в производстве дискретных полупроводниковых приборов и интегральных микросхем (ИМС), в других современных областях науки и техники
- формирование у студентов навыков проведения учебных и научных экспериментов;
- формирование комплексных профессиональных и общекультурных компетенций в сфере профессиональной и научно-исследовательской деятельности.

Задачи освоения дисциплины:

- формирование у студентов теоретических и практических знаний, умений и навыков, необходимых при разработке, исследовании и анализе различных физических и физико-химических процессов.
 - формирование у студентов определенных навыков экспериментальной работы;
 - освоение методов научных исследований.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Профессиональный электив «Материаловедение в микроэлектронике» относится в вариативной части Блока 1 цикла подготовки бакалавров по направлению **28.03.02.** «Наноинженерия», в котором изучаются физические и физико-химические процессы, лежащие в основе современных тонкопленочных, оптоэлектронных дискретных и интегральных полупроводниковых технологий.

В разделе изучаются различные способы роста и легирования монокристаллов, радиальные и осевые законы распределения примесей, способы получения однородных и бесдислокационных монокристаллов, контроль параметров монокристаллов, способы получения подложек из монокристаллов и физикохимические способы их обработки, окисление пластин и диффузионные процессы в них, способы формирования pn-переходов..

Освоение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплины ПЭ Материаловедение полупроводников и диэлектриков.

Результаты освоения дисциплины будут необходимы для освоения дисциплины ПЭ Физические основы технологии полупроводниковых приборов государственной итоговой аттестации.

Министерство образования и науки РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф – Аннотация рабочей программы дисциплины		THE

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Код и наименование	Перечень планируемых результатов обучения по		
реализуемой	дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами		
компетенции	достижения компетенций		
ПК-6	Знать:		
Проектирование	Основные подходы по математической обработке данных;		
приборов и устройств	основные методы роста объёмных монокристаллов; теорию и		
микроэлектроники и	практику диффузионных процессов и контролируемых методов		
управление их	создания рп-переходов.		
параметрами на основе	теорию и технологию роста диэлектрических плёнок на		
физико-химических	полупроводниковых структурах; технологические этапы		
свойства применяемых	изготовления и подготовки полупроводниковых подложек;		
материалов	Теорию и практику нанесения тонких металлических пленок		
	Уметь:		
	пользоваться современными методами обработки, анализа и		
	синтеза физической информации;		
	планировать и осуществлять учебный и научный эксперимент,		
	организовывать экспериментальную и исследовательскую		
	деятельность; оценивать результаты эксперимента;		
	Определять глубину залегания pn-перехода;		
	Определять ориентацию полупроводниковых		
	монокристаллических пластин по базовым срезам.		
	Определять ориентацию полупроводниковых		
	монокристаллических пластин по дефектам упаковки;		
	Определять толщины диэлектрических пленок		
	Владеть:		
	практическими навыками решения задач по основным разделам		
	физического материаловедения, опытом проведения		
	физического эксперимента;		
	Навыками проведения простейшего моделирования		
	диффузионных процессов; навыками физико-химической		
	способов выявления дефектов монокристаллических		
	полупроводниковых пластин		
	Навыками проведения расчета по определению толщины		
	эпитаксиальных пленок разрушающими методами;		
	практическими навыками термического окисления		
	полупроводников		
	Практическими навыками подготовки подложки и процесса		
	нанесения металлических пленок термовакуумным		
	испарением.		

4. Общая трудоемкость дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов).

5. Образовательные технологии

В ходе изучения дисциплины используются традиционные методы и формы

Министерство образования и науки РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф – Аннотация рабочей программы дисциплины		No. of the last of

обучения (лекции, в т.ч. с элементами проблемного изложения, семинарские и лабораторные занятия, самостоятельная работа).

При организации самостоятельной работы используются следующие образовательные технологии: самостоятельная работа, сопряженная с основными аудиторными занятиями (проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины); подготовка к тестированию; самостоятельная работа под контролем преподавателя в форме плановых консультаций, творческих контактов, внеаудиторная самостоятельная работа при выполнении студентом домашних заданий учебного и творческого характера.

6. Контроль успеваемости

Программой дисциплины предусмотрены виды текущего контроля: тестирование, устный опрос.

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет.